极高时间分辨Micromegas探测器 研究进展

刘建北 核探测与核电子学国家重点实验室 中国科学技术大学

核探测与核电子学国家重点实验室年会 2019-4-23

1

前言

- 高计数率环境下对带电粒子进行精确定时是下一代强子对撞机 实验上的一项重要探测需求。
 - 抑制堆积效应的影响
- •相关技术研发成为LHC实验升级中的一个热点(时间分辨~30ps)
 - ATLAS-LGAD
 - CMS-MTD





高计数率快速定时:皮秒Micromegas概念

- Micromegas: 抗辐照, 高计数率
- 时间分辨制约因素: 原初电离位置统计涨落 $\rightarrow \sigma_r = \lambda/\nu$ ~几个ns



契伦科夫+光阴极+MM → 消除原初电离位置涨落的影响

工作基础: 单通道原理样机



探测器有效面积约1 cm²





Time Resolution of USTC psMM detector(5.5nm Cr +18nm Csl)

时间分辨可以好于50ps





稳定工作在高增益,减小离子反馈, 能保护Csl光阴极,有效延长其寿命。





探测器实物图

利用激光测试单光子响应



CERN束流测试



150 GeV muon



- 探测器可以工作在0.25%的很低的离子反馈,此时得到的时间分辨为180ps。(drift: 400V/cm, gap1: 42.5kV/cm, gap2: 36kV/cm)
- 通过扫描电压,探测器可得到80ps以下的时间分辨。

尝试发射式双丝网MM结构





Csl镀层疑遭损坏,没有得到系统性测试结果。

新型光阴极研究



磁控溅射原理图



镀膜设备实物图



9





西安光机所深紫外光测试系统

以10纳米样品的测试结果作为归一化因子,得 到如上图所示的相对量子效率分布。比较可知, 当DLC的厚度为2,5nm时,具有最佳量子效率。

.

160

150

1 1 1 1

170

+ Thickness: 1 nm

Thickness: 2.5 nm

Thickness: 5 nm

Thickness: 10 nm

180 190 200 Wavelength (nm)

10

2

0 [[

120

140

130

Relative Quantum Efficiency

10

带有DLC光阴极快速定时MM的束流测试



用于DLC测试的快速定时MM探测器设计图及在束流实验中的实景图

光电子产额及探测效率

Thickness of DLC film (nm)	N _{pe} /per muon	Detection efficiency for muons
1	Bad	Bad
2.5	3.7	97%
2.5	3.5	95%
2.5	3.4	94%
5	3.4	94%
7.5	2.2	70%
10	1.7	68%

Radiator MgF2 (mm)	Photocathode	N _{pe}
3	Cr + Csl(2 nm MgF ₂ layer)	<1
3	Cr + Csl(2 nm MgF ₂ layer)	3.55
3	20 nm Cr	0.66
3	6 nm Al	1.69
5	10 nm Cr	2.15
5	10 nm Al	2.20
3	2.5 nm DLC	3.7
3	5 nm DLC	3.4

厚度为2.5纳米的DLC样品性能表现最好, 与标 准Csl光阴极相比, 光电子产额为其~50% 左右。

与其他新型光阴极相比,DLC光阴极具 有很好光电子产额,还有很好的耐用性。





总结及展望

- Micromegas结合契伦科夫机制可以实现高计数率下的精确定时
- 在完成了这一探测器概念的初步原理验证基础上,探索了新的探测器结构和新型光阴极
 - 双丝网MM在保持中等的时间分辨(180ps)情况下,可以有效减小离子 反馈。
 - DLC光阴极光电子产额~50% Csl, 令人鼓舞。
- 值得继续探测的探测器技术!

感谢重点实验室对本工作的大力支持!